W47b X-mas 計画における X 線発生装置の評価

荻田 喬行、北本 俊二、大久保 洋輔、斉藤 恒介、柴田 拓磨(立教大学)

現在のX線望遠鏡は、理論上の角度分解能の限界、つまり回折限界に達してI1なI1。立教大学では、回折限界に近I1精度の望遠鏡の開発を目指す計画、X1-mas 計画(X1-ray Milli Arc Second Project)を行ってI1る。X1-mas 計画では、非球面鏡を使ったI2 線の直入射光学系の望遠鏡を開発する。検出器には裏面照射型のI2 Dを使用し、直入射でも十分な反射率が得られる I3 5 (0.09kev)のI3 な線を線源として利用する。これまでの研究より I3 を線源とすることで I3 5 のI3 のI3 のI3 ないかってI3 のI3 のI3 のI3 に対力がってI3 のI3 のI3 に対力がってI3 のI3 に対力がってI3 のI3 に対力がってI3 のI3 に対力がってI3 のI3 に対力が I4 に対力が I5 に対力が I5 に対力が I5 に対力が I5 に対力が I6 に対力が I7 に対力が I8 に対力が I9 に対力が I9

高精度のX線検出器開発のためには、X線発生装置からできるだけ多くのX線を放射させる必要がある。

X線発生装置では、陰極であるフィラメントから熱電子を出し、電圧をかけて加速させる。その加速された熱電子を Al/Si のターゲット(陽極)にあてると、ここで制動放射と供に、Si-L X線(135)が放射される。この X線をより多く発生させるために、陰極・陽極の電圧を変化させて、線強度との相関を調べた。

今後は、より高精度の検出を得るために装置の改良を行っていく。